Delphion Intellectual Property Network

IPN Home | Search | Order | Shopping Cart | Login | Site Map | Help





P3214217A2: STYLUS PEN

ew Images (1 pages) | View INPADOC only

Country:

Kinde

Inventor(s):

Applicant(s):

Issued/Filed Dates:

Application Number.

IPC Class:

Abstract:

JP Japan

OSAKA YOSHIHISA

HITACHI SEIKO LTD

News, Profiles, Stocks and More about this company

Sept. 19, 1991 / Jan. 19, 1990 -

JP1990000008325

G06F 3/03;

Purpose: To accurately detect the pressing force of a stylus pen with a minute displacement of an indicator by interlocking rotatably a plate spring between the indicator and the other end of a case, and providing a strain gauge to the plate spring.

Constitution: When a contact is secured between the tip of an indicator 2 and an optional point on the tablet surface, the force is applied in the lengthwise direction of a plate spring 5 in accordance with the contact force. Thus the spring 5 has a malformation and therefore a strain gauge 6 also has a malformation. Then the gauge 6 detects the value accordant with the contact pressure. Meanwhile the spring 5 itself and then the gauge 6 have virtually no malfunction when the force rectangular to the lengthwise direction of the spring 5 is applied to a stylus pen. Then no force is detected in the rectangular direction and only the contact pressure is detected. Thus it is possible to detect the pressure with high accuracy with a minute moved variable.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

Other Abstract Info:

Foreign References:

Powered by and Net.Data

Nominate this inv ntion for the Gallery. none

(No patents reference this one)

Alternative Searches







Boolean Text

Browse



U.S. Class



U.S. Class by number IBM Technical Disclosure Bulletin

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-214217

@Int.Cl. 3

識別記号 庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)9月19日

G_06_F__3/03

3 1 0 H

7629 - 5B

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

❷発明の名称

スタイラスペン

②特 願 平2-8325

義 久

20出 願 平2(1990)1月19日

@ 形 者

大 坂

神奈川県海老名市上今泉2100番地 日立精工株式会社内

创出 願 人 日立精工株式会社

神奈川県海老名市上今泉2100番地

四代 理 人 弁理士 武 顕次郎

外1名

明和書

1. 発明の名称

スタイラスペン

2. 特許請求の範囲

(2)請求項(1)において、前記板ばねは、前記 各端部に係合する両端部分と、この両端部分に進 税して形成され当該両端部分に対してそれらの軸 方向と直角方向にずれを有し、かつ、前記ひずみ ゲージが設けられた中央部分とで構成されている ことを特徴とするスタイラスペン。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、座標検出装置で使用されるスタイ ラ スペンに関する。

[従来の技術]

た点の座標が検出される。

近年、このようなスタイラスペンがタブレットに 接触せしめられたときの圧力を発揮させたに力 で強性しめられたときの歴能を発揮させたは によっている。例は、タブレッに応じて で楽されている。例に、タブレッに応じない。 ない、スタイラスペンのがは、タブレッに応じないない。 ない、スタイラスペンのがよいで、ない。 は、コイル、スタイラスペンのがよいで、はない、ないのよりはない。 で変したが、スタイラスペンのがよいで、はない、はないのはないにより構成ではない。 でタイラスペンの押圧が倒して、ないとより、 スタイラスペンの押圧が検出されるようになって、 スタイラスペンの押圧が検出されるようになって、 スタイラスペンの押圧が検出されるようになって、 スタイラスペンの押圧が検出されるようになって、

[発明が解決しようとする課題]

ところで、上記圧力校出機構を備えたスタイラ スペンにおいて、圧力の大きさを精度良く検出す るためには、前記コアの移動量、即ちタブレツト

[作用]

指示体の先端をタブレットの表面の任意の点に接触させると、その接触圧力に応じた力が板ばねの長さ方向に加わり、板ばねに変形を生じる。これにより、ひずみゲージにも変形が生じ、上記を触圧力に応じた値が検出される。一方、スタイラスばね自体にはほとんど変形を生じず、前記直角方向の力は検出されず、接触圧力のみを検出することができる。

[実施例]

以下、本発明を図示の実施例に基づいて説明する。

第1図(a)は本発明の実施例に係るスタイラスペンの側面断面図、第1図(b)は第1図(a)に示す線1b-Ibに沿う断面図である。各図で、1は合成樹脂で細長く作られたケース、1aはケース1の中空部、1bはケース1の右端壁中央にあけられた貫通孔、1cは前記右端壁に形成された肩

と接触するスタイラスペンの 先端の種方向移 動 最を相当程度大きな最としな ければならないが、 このようにスタイラスペンの 先端の軸方向移動 量 が大きいと使用中の変動も大き くなり、スタイ ラスペンとして使用しにくいという問題があつた。

本 免明の目的は、 微小な 移動 量で精度良く 圧力 を検出することができる スタイラスペンを 提供するにある。

[課題を解決するための手段]

部である。2はケース1の貫通孔1bに揮通され た指示体、2aはケース1から突出した指示体2 の先端、2bはケース1の中空部1aに位置する 指示体2のつば部、2 c は指示体2の他端に形成 されたV字状の潜である。 3 はケース1の肩 1 c と指示体2のつば2bとの間に装架されたコイル ばねであり、指示体2を図で左方に付勢している。 4はケース1の右端壁に 固定された保持体、 4a は保持体4の先端に形成されたV字状の溝である。 5は版ばねであり、指示体2のV字状の牌2cと 保持体4のV字状の溝4aとの間に装架されてい る。このような構成により、 板ばね5にはコ イル ばねるの小さな圧力が付与されて各溝2c. 4 a からの脱落が防止される。 換言すれば、板ばね5 は渡2c、4aに小さな圧力で押圧係合されてい るのみである。この板はね5は両端節5a および 第1図(a)で当該両端部5 a から上方へもち上つ た中央部5 りを有する。6 は中央部5 bの両面に 貼者されたひずみゲージを示す。ひずみゲー ジ6 は変形によりひずみを生じ、そのひずみに応 じて

抵抗値を変化させる。なお、図示のスタイラスペンでは、前述の電磁手段の図示は省略されている。 次に、本実施例の動作を第2回および第3回を 参照しながら説明する。これら第2回および第3 図は第1回(a)に示すものと同じ側面断面図で、 第1回(a)に示すものと同じ側面断面図で、 第1回(a)に示すものと同じ側面断面図で、 のしてある。今、オペレータがこのスタイラスペントの任意の点を指示体2の 先端2aにより指示すると、先端2aには第2の 先次のにより指示すると、先端2aには第2の に矢印入で示すようにタブレントの軸心(一点領 様々2は板ばね5のばれ力に抗して破線で示すよう に変化する。これに伴い、ひずみゲージ6も変形

し、上面のひずみゲージ6には伸びが、下面のひ

ずみゲージ6には縮みが生じ、これに応じて各ひ

ずみゲージ 6 の抵抗値が変化する。これらの抵抗

仮の変化を図示しない検出回路で検出することに

より、指示体2の先端2aに作用した押圧力、即

ちオペレータがスタイラスペンを押圧した圧力を

検出することができる。ひずみゲージの抵抗 値 の変化はひずみゲージの質かな変形においても 鋭 敏に検出することができるので、 指示体 2を大き く変位させる必要はない。

この検出された圧力は、コンピュータより成る 制御部において目的に合致した 服様で利用される。 例えば、前述の線の大さの決定に利用する以外に も、オペレータがタブレット上に文字を描く場合、 当該文字が描かれたときの 各部分の押圧力を利用 して、図示されない表示装置やプリンタ等に、 恰 かも当該文字が毛筆で描かれたように表示、印刷 することが可能となる。

ところで、前述のように、スタイラスペンは通常の筆記具とその形状、寸法、重量を類似させることが望ましい。このため、検出 1 に剛性の大きな材料を使用したり、ケース 1 の厚みを大きくしたりすることはできず、必然的に厚さの薄い合成樹脂等を用いてケース 1 を形成せざるを得ない。したがつて、スタイラスペンにその軸心方向に対して垂直方向成分の力が作用するとスタイラスペ

ンのケースは容易に変形する。そして、このような変形により前記垂直方向成分の力が検出されると、スタイラスペンの押圧力とは無関係の力が押 圧力として検出されることになり、正確な押圧力 の検出は不可能となる。

方向成分の力が作用しても、この方向は板ばね5の幅方向であるので、板ばね5のこの方向の力成分に対する剛性は高く、板ばね5、したがつてひずみゲージ6にはほとんど変形は生じない。

なお、上記実施例の説明では、指示体および保持体に 持体と仮ばねとの係合を、指示体および保持体に 形成したV字状の薄により線接触係合とする例に ついて説明したが、板ばねの両端を尖端とし、か つ、指示体および保持体の荷記溝を円錐形の溝と し、点接触係合とすることもできる。又、ひずみ ゲージは、いずれか…方の面のみに貼着してもよ いのは明ら かである。 【発明の効果】

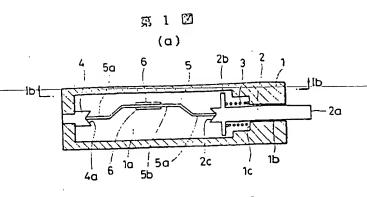
以上述べたように、本発明では、指示体とケース他端との間に被ばねを回動可能に係合し、当該 被ばねにひずみゲージを設けるようにしたので、 指示体の微小な変位でスタイラスペンの押圧力を 正確に検出することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回(a),(b)は本発明の実施例に係るスタイラスペンの側面断面図および平面断面図、第2図および第3図は第1図(a),(b)に示すスタイラスペンの動作を説明する側面断面図である。

1……ケース、2……指示体、2c……溝、3 ……コイルばね、4……保持体、4a……溝、5 …… 板ばね、6……ひずみゲージ。

代理人 弁理士 武 颐次郎(外1名)



1:ケース 4:保持体 6:ひずみゲージ 2: 指示体 5: 板はね

